

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】令和 7 年 1 月 27 日 (2025.1.27)

【公開番号】特開 2023-134298 (P2023-134298A)
【公開日】令和 5 年 9 月 27 日 (2023.9.27)
【年通号数】公開公報 (特許) 2023-182
【出願番号】特願 2022-39755 (P2022-39755)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/52 (2006.01)

10

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/52 F

H 0 1 L 21/60 3 1 1 T

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 1 月 17 日 (2025.1.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0055

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0055】

例えば、図 7 (b) に示すアタッチメント領域 P o における補正係数を C a 、図 7 (c) に示すアタッチメント領域 P o における補正係数を C b とすると、C a 、C b は下記の式 (1) 、 (2) により算出される。ここで、C a は図 5 に示すアタッチメント領域 P 1 の補正係数である。また、C b は図 5 に示すアタッチメント領域 P 3 の補正係数である。

30

40

50